

3.3.4 産官学の連携

産官学の連携としては、平成 18 年度に、EUVA(極端紫外線露光システム技術開発機構)における次世代半導体露光システムの高精度光学素子の加工技術と、また高効率 UV 発光素子用半導体開発プロジェクトにおける窒化物半導体基板の無歪加工プロセスの開発を成功裏に終えることができた。また、官学連携としては、新しい抗癌剤の開発を目的とした医工連携プロジェクトを国立国際医療センター研究所および理化学研究所(SPring-8)と推進し、抗癌剤の耐性について新しい知見を得た。さらに、新しい半導体デバイス用基板の開発およびデバイス開発を東北大学と、超精密形状計測法の開発を高エネルギー加速器研究機構と、高機能デバイス用材料開発および新しい表面計測技術の開発を物質・材料研究機構と、超純水のみを用いた低環境負荷型の半導体基板加工装置の開発や液晶ディスプレイ用高機能薄膜及び高効率太陽電池の特性および生産性の向上を目的とした共同研究を民間企業と進めており、いずれのプロジェクトにおいても実用化により社会貢献が期待できる。

そして、平成 19 年度からは、シャープ(株)と電子デバイス生産技術共同研究講座を設立し、液晶ディスプレイ、太陽電池、半導体デバイスの革新的な生産技術を開発することになる。本拠点の技術シーズを実用化してさらに産業界への大きな貢献が期待できる。

今後は、国家プロジェクトへの参画や学一学連携はもとより、研究成果を実用化して産業界へ貢献することを目的に、より多くの産学連携を推進する予定である。その中でも、さらなる共同研究講座の設置は、望まれるところである。